大石　耕一郎　OISHI,Koichiro

キーワード

結晶 / 太陽電池 / 薄膜 / エピタキシャル成長

分野等　応用物性、結晶工学、電気電子材料工学

email　oishi[at]nagaoka-ct.ac.jp　※ [at] を @ に変えてください

職名　教授

学位　博士（工学）

研究分野

無機化合物材料の作製とデバイス化に関する研究

興味のあること・技術 PR

真空中熱処理

　熱処理用アンプル（内径 17 mm）内への真空封入と熱処理（1,200 °C 程度まで）に対応。

表面観察

　デジタルマイクロスコープを用いた光学観察各種と SEM 観察が可能。

定性分析、定量分析

　EDS 元素分析（定性及び定量）、X 線回折による定性分析及び結晶相の定量分析、結晶性評価、配向評価等

特別設備

- 真空封入装置
- 電気炉
- デジタルマイクロスコープ観察評価システム（キーエンス VHX-1000 一式、共同利用設備）
- 走査電子顕微鏡（日本電子 JSM-IT200、JCM-7000、共同利用設備）
- 多目的 X 線回折分析評価システム（リガク RINT-Ultima III、MiniFlex、共同利用設備）

企業との連携実績

- 受託分析
- 技術相談支援（旧・地域共同テクノセンター）
- NPO 法人長岡産業活性化協会 NAZE 理事（H27.5–H31.3）
- 工場見学の企画・相談（アルプスビジネスクリエーション 様）

真空封入装置

電気炉

デジタルマイクロスコープ観察評価システム

多目的 X 線回折分析評価システム

学生の主な就職先

R04：第一工業株式会社，倉敷機械株式会社

R03：株式会社シークス，パナソニックシステムソリューションズ，株式会社システムスクエア

R02：株式会社トクサイ

R01：第一工業株式会社

H30：SUBARU テクノ株式会社，株式会社トノックス，株式会社小田原オートメーション長岡，株式会社アドテックエンジニアリング，テックプロジェクトサービス株式会社